LIQUID CRYSTAL ORIENTATION AGENTS AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE WITH THE USE THEREOF

Publication numbe	r: WO02100949 (A1)		Also published as
Publication date:	2002-12-19	固	EP1403325 (A1)
Inventor(s):	YAMADA TOMOHISA [JP]; FUKURO HIROYOSHI [JP]; ENDO HIDEYUKI [JP] +	型 Dus	EP1403325 (B1)
Applicant(s):	NISSAN CHEMICAL IND LTD [JP]; YAMADA TOMOHISA [JP]; FUKURO HIROYOSHI [JP]; ENDO HIDEYUKI [JP] +		US7144607 (B2) TW245948 (B)
Classification:			1W245540 (B)
- international: - European:	C08G73/10; C08K5/18; G02F1/1337; C08G73/10; C08K5/00; G02F1/13; (IPC1-7): C08G73/10; C08K5/18; C08L79/08; G02F1/1337. C08G73/10; G02F1/1337C3; C08K5/48	(A)	more >>
Application numbe	r: WO2002JP05798 20020611		JP9298089 (A)
	: JP20010176630 20010612		JP6338392 (A)
rnonty number(s)	, u 2000 (1000 0000 0000 0000 0000 0000 000		JP62280288 (A) US3990984 (A)
Abstract of WO 02: Polyimide-based lic containing the stru- formula (I): (I) whel a divalent organic (R <sp>4</sp>		R ³	

(19) 日本国特許庁(JP)

(51) Int. C1.7

再 公 表 特 許(A1)

(11) 国際公開委号 W02002/100949

発行日 平成16年9月24日 (2004, 9.24)

(43) 国際公開日 平成14年12月19日 (2002, 12, 19)

COSK COSK	79/08	CO9K CO8K	79/08	z		
			套	在請求 未請求	予備審査請求 有	(全 21 頁)

RІ

出願番号	特願2003-503710 (P2003-503710)	(71) 出願人	1
(21) 国際出駐番号	PCT/JP2002/005798		1
(22) 国際出願日	平成14年6月11日 (2002.6.11)		-
(31) 優先權主張番号	特膜2001-176630 (P2001-176630)	(74)代理人	1
(32) 優先日	平成13年6月12日 (2001, 6, 12)		
(33) 優先權主張国	日本国 (JP)	(74)代理人	1
(81) 指定国	AP (GH, GN, KR, LS, HW, MZ, SD, SL, SZ,		4
TZ, UG, ZN, ZW), EA (AH,	AZ, BY, KG, KZ, ND, RU, TJ, TM), EP (AT,	(74)代理人	1
BE, CH, CY, DE, DK, ES, F	I, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE		4
, TR) , OA (BF, BJ, CF, CG	, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,	(72) 発明者	1
TD, TG), AE, AG, AL, AM,	AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, C		
H, CN, CO, CR, CU, CZ, DE	, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, F1, GB, GD, GE,	1	1
GH, GM, HR, HU, 1D, 1L, 1	N, IS, JP, KR, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS	(72) 発明者	4
, LT, LU, LV, MA, ND, MG,	MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, P	l	-
T, RO, RU, SD, SE, SG, S1	, SK, SL, TJ, TN, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,		ź

1) 出願人 000003986

日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

(4)代理人 100090918

弁理士 泉名 **飲治** 74)代理人 100082887

弁理士 小川 利春

人 100072774 弁理士 山本 量三

肾 山田 智久 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化

李工業株式会社 電子材料研究所内 袋 裕善 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化

学工業株式会社 電子材料研究所内

最終頁に続く

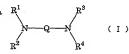
(54) [発明の名称] 被蟲配向処理剤及びそれを用いた液晶表示素子

(57) 【要約】

US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW

ポリイミド系の液晶配向処理剤中に、式(I)で示される構造を含有させる。





(ただし、式(I)中のQは単結合または2価の有機基を表し、 $R^1\sim R^4$ は五いに異なっても同じでも良い。)

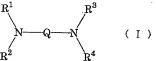
20

40

【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記の式 (I) で示される構造を含有することを特徴とするポリイミド系の液晶配向処理 剤。



(ただし、式 (I) 中のQは単結合または2個の有機基を表し、 $R^1 \sim R^4$ は芳香族基を表し、 $R^1 \sim R^4$ は芳香族基を表し、 $R^1 \sim R^4$ は互いに異なっても同じでもよい。)

【請求項2】

ポリアミック酸およびポリイミドから選ばれる少なくとも1種の重合体と、式(1)で示される構造を有する6枚ないが、または重合体とを含有する6枚求り1に記載の液晶配向処理剤。

【請求項3】

式 (I) で示される構造を有する、ポリアミック酸およびポリイミドから選ばれる、少なくとも1種の重合体を含有する請求項1に記載の液晶配向処理剤。

【請求項4】

式 (I) で示される標準を有する化合物をポリアミック酸及びポリイミドから選ばれる少なくとも1種の重合体を含有する溶液に混合させたものである前求項 2 に記載の液晶配向 処理剤。

【糖求項5】

式(1) で示される構造を有する重合体をポリアミック酸及びポリイミドから選ばれる少なくとも1種の重合体を含有する溶液に混合させたものである請求項2 に記載の液晶配向 処理剤。

【請求項6】

式 (1) で示される様途を直接導入した、ポリアミック酸またはポリイミドから選ばれる 30 少なくとも1種の重合体を含有する溶液である請求項3に配載の液晶配向処理剤。

【請求項7】

式 (I) で示される構造を有する、ポリアミック酸またはポリイミドが、テトラカルポン 酸二無水物と、式 (I) で示される構造を有するジアミンを含むジアミンとを反応させて 得られたものである前求項3または6に記載の被晶配向処理剤。

【請求項8】

請求項1~請求項7のいずれか1項に記載の液晶配向処理剤から形成された液晶配向膜を 備えた液晶表示薬子。

【発明の詳細な説明】

技術分野

背景技術

液晶表示素子は、現在ネマティック液晶を用いた表示素子が主流であり、90° ツイスト したツイストネマティック (TN) 素子、適常180°以上ツイストしたスーパーツイス トネマティック (STN) 素子、薄膜トランジスターを使用したいわゆるTFT液晶素子 、更には、視角特性を改良した横電界型の液晶表示案子、垂直配向型の液晶表示案子等と 種々の方式による表示素子が実用化されている。

これら表示素子用の液晶配向膜としては、ポリイミド前駆体や可溶性ポリイミドの溶液、

もしくはこれらの混合溶液を塗布、焼成した後、ラビングなどによる配向処理をし、また

(3)

は、焼成袋に特別な配向処理はしないで用いることが工業的に広く用いられている。 この溶晶配向膜に求められる特性としては、透明性、耐熱性、耐薬品性などの基礎的な物 性はもとより、良好な液晶配向性、安定で適切な大きさを持った液晶領部配向角といった 液晶との界面特性、さらには液晶表示業子を駆動させた膜の、電圧保持率、電荷蓄積量と いった常気動性など、様々な夢まが挙げられる。

また、液晶表示案子の製造上の概点からは、液晶配向処理剤の保存安定性、基板に対する 印刷性などのワニス特性や、その塗膜をラピング処理する際の傷、削れ耐性、静電気の発 件し島と故け品さなどの特性も重要となる。

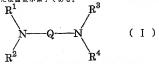
上記特性の内、電圧保持率、電荷蓄積量などの電気特性は、TFTなどのアクティブマトリクス駆動方式を用いた接急をルでは特に痩要なものであり、様々な手法が提案されている。例えば、特開率6-228061号公標では、ポリイミド舎枠中のエーテル結合が電気特性を駆化させることに着目し、ポリイミドの原料としてエーテル結合を含まない特定構造のジアミノ化合物を提案している。また、特関平8-76128号公線では、ポリイミド系の高分子にカルボン酸無水物基や3級アミン基を一個持つ化合物を添加する方法が番密されている。

発明の開示

本発明が解決しようとする懸題は、ネマティック被晶を用いた種々の表示素子に用いられるポリイミド系の被晶配向膜において、電圧保特率を向上し、または殆ど低下させず、かつ蓄積電荷を伝統するための新たな手段の提供である。

本発明者は上述した問題を解決するための手段を鋭意検討した結果、ポリイミドやポリイミド前駆体を主成分とする被島配向膜(本発明では、ポリイミド系の液島配向膜という)を形成させるための組成物(本発明では、ポリイミド系の液晶配向処理剤という)に特定の構造を含有させることによって、蓄積電荷特性、電圧保持特性といった電気特性を向上させることを見出すに至ったものである。

即ち、本発明の核晶配向処理剤は、下記式(I)で示される構造を含有するポリイミド系 の核晶配向処理剤であり、本発明の被晶表示素子は、鉄液晶配向処理剤から形成される被 晶配向膜を備えた液晶素素示薬子である。



(ただし、式(I)中のQは単結合または2値の有機基を表し、R 1 ~R 4 は芳香族基を表し、R 1 ~R 4 は万香族基を表し、の 1 ~R 4 は互いに異なっても同じでも良い。)以下に、本発明を詳細に説明する。

本発明のポリイミド系の液晶配向処理剤は、式(I)で示される構造を含有することを特数とするものであって、その含有影性は特に限定されない。式(I)で示される構造を含有する不発明のポリイミド系の被晶配向処理剤の好ましい態様としては、ポリアミック酸及びポリイミドから遊ばれる少なくとも1種の重合体と式(I)で示される構造を有する化合物および/または重合体とを含有することを特徴とする液晶配向処理剤や、式(I)で示される構造を有する、ポリアミック酸及びポリイミドから選ばれる少なくとも1種の富合体を含有することを特徴とする液晶配向処理剤などが挙げられる。

更に、本祭明の被晶配向处理剤の好ましい具体的例としては、 $\triangle 1 \lor$:式(I) で示される構造を有する化合物(以下、化合物 [a] とする)をポリアミック酸及びポリイミドから避ばれる少なくとも1種の重合体を含有する溶液に混合させたもの、 $\triangle 2 \lor$:式(I) で示される構造を有する重合体(以下、重合体 [b] とする)をポリアミック 酸及びポリイミドから遊ばれる少なくとも1種の重合体を含有する溶液に混合させたもの、 $\triangle 3 \lor$: ズ(I) で示される構造を直接率入した、ポリアミック酸またはポリィミドから遊ばれる

少なくとも1種の重合体(以下、重合体[c]とする)を含有する溶液、が挙げられる。また、本発明の液晶配向処理剤では、これら▲1▼~▲3▼を複合して用いることもも落るん好ましい。なかでも、▲3▼においては、式(I)の構造が液晶配向膜中に確実に導入され、混合物に伸なう相溶性や成分の凝集といった問題が回避できるので特に好ましい

本発明の液晶配向処理剤に含有される上記式 (I) の構造において、Qは単糖合または2 値の有機基であり、2 値の有機基は特に限定されないが、その具体例としてメチン茎、 マトルン型を表している。アトー〇アトー、一アトーCH2ーアトー、一CH2ー PトーCH2ー及び芳香環が挙げられる。ここで、芳香環としてはフェニル基、ピフェニル基、ターフェニル基、ナフナンと、アントラセン基、スルオンン基などが挙げられる。

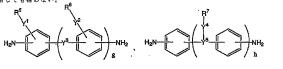
上記2僅の有機基は、匿換、又は無匿換であっても良い。その場合の匿換基は、炭素数1 ~20のアルキル基、炭素数1~20のアルコキシル基、臭素、ヨウ素、フッ素、塩素、 又はトリフルオロメチル器である。好ましいQとしては、フェニル器、ピフェニル器、ターフェニル器、ナフチル器、一CH₂ーPh-CH₂ ー、フルオレン器、メチレン基、エ チレン器、又はプロピレン基である。

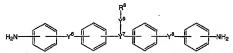
式 (1) においてR¹ ~R⁴ は芳香族基であり、特に限定されないが、具体的にはフェニル基、ピフェニル基、ターフェニル基、ナプチル基、フェナントレン機、ピレン基、ペリレン基、アントラセン基、フルオレン基であり、大事しくはフェニル基、ピフェニル基、ターフェニル基、サフチル基、フルオレン基である。これらは屋袋、又は無屋袋であっても良く、その産接基は、炭素数1~20のアルキル基、炭末数1~20のアルコキシル基、アミノ基、水酸基、臭素、ヨウ素、フッ素、塩素、又はドリフルオコメチル基である。本発明の、前配▲1▼および▲2▼の形態に用いられるポリアミック酸は、一般的に液晶配同膜として用いられるポリアミック酸であり、特に限定されないが、これらは通常テトラカルポン酸二無水物とジアミン化合物とを有機溶媒中で反応させることにより得ることができる。

ポリアミック酸の合成反応に用いられるテトラカルボン酸二無水物としては、ピロメリッ ト酸、2.3.6.7-ナフタレンテトラカルボン酸、1.2.5.6-ナフタレンテト ラカルボン酸、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルボン酸、2,3,6,7-アント ラセンテトラカルボン酸、1,2,5,6-アントラセンテトラカルボン酸、3,3, 4.4'-ピフェニルテトラカルボン酸、2,3',4-ピフェニルテトラカルボン 酸、ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) エーテル、3, 3'4, 4'-ベンゾフェノ ンテトラカルボン酸、ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) スルホン、ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) メタン、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル) プロパ ン、1、1、1、3、3、3-ヘキサフルオロー2、2-ビス(3、4-ジカルボキシフ ェニル)プロパン、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシラン、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル) ジフェニルシラン、2、3、4、5-ピリジンテトラカルボ ン酸、2.6-ビス(3.4-ジカルボキシフェニル)ピリジンなどの芳香族テトラカル ボン酸の二無水物、1、2、3、4-シクロプタンテトラカルボン酸、1,2,3,4-シクロペンタンテトラカルボン酸、1,2,4,5-シクロヘキサンテトラカルボン酸、 2. 3. 5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸、3, 4-ジカルボキシ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸などの脂環式テトラカルボン酸の二無水物、 1. 2. 3. 4 - プタンテトラカルボン酸などの脂肪族テトラカルボン酸の二無水物など が挙げられる。これらの酸二無水物は単一の化合物を使用してもよく、複数の化合物を併 用することもできる。

ポリアミック酸の合成反応に用いられるジアミン化合物としては、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、2,5-ジアミノトルエン、2,6-ジアミノトルエン、4,4'-ジアミノビフェニル、3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノビフェニル、3,3'-ジストキシー4,4'-ジアミノビフェニル、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルエーテル、2,2'-ジアミノジフェニルプロパン、ビス(3,5-ジアミノジフェニルエーテル、2,2'-ジアミノジフェニルプロパン、ビス(3,5-ジ

さらに、上記ジアミンには、液晶傾斜配向角を高める目的で下配の構造などのジアミンを 併用しても構わない。





上記式中、 R^8 、 R^7 、 R^8 はそれぞれ独立に炭素数 6 以上の置換基を示し、 Y^1 、 Y^2 、 Y^4 、 Y^6 、 Y^8 、 Y^9 はそれぞれ独立に単結合、エーテル結合、エステル結合 またはアミド結合を示し、 Y^3 は単結合または炭素数 $1\sim5$ の直鎖状アルキル基または炭素数 $1\sim5$ のの整数を有するアルキル基を示し、 Y^5 、 Y^7 は炭素または産素を示し、 Y^8 00 の整数 、 ははから $1\sim5$ の整数を示す。

被品類斜配肉角の大きさは、上配側鎖を有するジアミンの、棚鎖の大きさや歯によって変 化するが、側鎖の製薬数が6未満ではその導入効果が期待できず、炭薬数が6以上であっ でも、そのジアミンの使用量が5年ル外未満では導入効果が小さい。

ポリアミック酸の合成反応に用いられるテトラカルポン酸二無水物とジアミン化合物の使用割合は、テトラカルボン酸二無水物のモル数に対し、ジアミン化合物のモル比で0.8 ~1.2であることが好ましい。通常の重縮合反応同様、このモル比が1.0に近いほど 生成する重合体の重合度は大きくなる。

重合度が小さすぎるとそこから得られる詮褻の強度が不十分となり、重合度が大きすぎる と詮褻形成時の作業性が悪くなる場合がある。従って、本反応における生成物の重合度は 、 GPC (Gel Permeation Chromatography) 法で測定し た電量平均分子量 (Mw)で2千~50万とするのが好ましい。

ポリアミック酸の合成反応は、有機溶媒中で、通常0~150℃、好ましくは0~100℃の反応程度で行われる。上記有機溶媒としては、反応で生成する反応物を溶解しうるものであれば特に制限はない。その具体例を挙げるならば、N,Nージメチルルカアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2~ピロリドン、Nーメチルカプロラクタム、ジメチルスルホキシド、テトラメチル展業、ピリジン、ジメチルスルホン、ヘキサ

メチルスルホキシド、ァーブチロラクトン等が挙げることができる。これらは単独でも、また選合して使用してもよい。さらに、ポリイミド前駆体を溶解しない溶棄であっても、 重合反応により生成したポリイミド前駆体が析出しない範囲で、上記溶薬に混合して使用 してもとい。

上記有機溶媒の使用量は、通常、テトラカルポン酸二無水物およびジアミン化合物の総量が、反応溶液の全量に対して0.1~30重量%になるようにするのが好ましい。

このようにして得られたポリイミド前駆体はそのまま使用することもでき、またメタノール、エタノール等の貨裕線に沈殿単離させて回収した後、適当な溶媒で再溶解して用いてもよい。 再溶解させる密媒は、得られたポリイミド前駆体を溶解させる物であれば特に度 定されないが、その具体例としては、例えば、N-メチル・2 ー ピロリドン、N、N-ジメナルアセトアミド、N、N-ジメナルホルホナンド、ソーブ・ロラクトン、テトラメテル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミドなどの非プロトン系種世溶媒、 m - クレゾール、キシレノール、フェノール、ハロゲン化フェノールなどのフェノール系数数を挙げることができる。

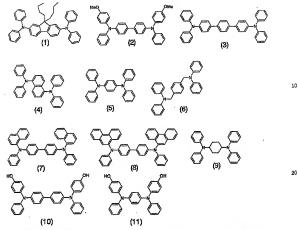
本発明において、前記▲1▼および▲2▼の形態に用いられるボリイミドは、一般的に液 品配向膜として用いられる有機溶練可溶性のポリイミドであり、特に販さされるもでは ない。ここでいうボリイミドとは、ポリアミック酸の繰り返し単位の全でボイミド化(規 水閉葉)されていないものであっても、その範疇に含まれ、本発明の液晶配向処理剤にも 好適に用いられる。これらは通常、対応するポリアミック酸を溶液中で加熱もしくは触媒 の類如により、脱水関葉させることにより得ることができる。

審接中でポリアミック酸を加熱する方法における反応程度は、通常50~200℃とされ、好ましくは60~170℃とされる。反応程度が50℃未満では既水開課反応が十分に通行せず、反応程度が200℃を超えると得られるイミド化重合体の分子量が低下することがある。

ポリアミック酸の溶液中に脱水剤および脱水関環触媒を添加しイミド化する反応において、脱水剤としては、例えば無水酔酸、無水プロピオン酸、無水トリブルオロ酔酸などの酸 継水物を用いることができる。脱水剤の使用量は、ポリアミック酸の鶏り運し単位1モルに対して0.01~20モルとするのが好ましい。また、脱水関環触媒としては、例えば ビリジン、トリエチルアミンなどの3級アミンを用いることができる。此水関環触媒の使 用量は、使用する脱水剤1モルに対して0.01~10モルとするのが好ましい。なお、 脱水関環反応に用いられる有機溶媒としては、ポリアミック酸の含成に用いられるものと して例示した有機溶媒を挙げることができる。そして、脱水関環反応の反応温度は、適常 0~180℃、好ましくは10~150℃とされる。

本発明の、前配▲ 1 ▼ および▲ 2 ▼の形態では、上配ポリアミック酸とポリイミドとの混合物であっても構わない。

本発明の、前記▲1▼の形態で用いられる化合物 [a]は、式 (I)で示される構造を有する三級ジアミン化合物であり、特に限定はされないが、その具体例の一部を下記に示す



本発明の、前配▲1▼の彩線における、化合物 [a] の混合量は、ポリアミックト酸大ポリイミドから避ばれる少なくとも1種の底合体の樹脂重量に対し、重量比で、0.01~ 0.5であり、好ましくは、0.1~0.3である。化合物 [a] の混合量が少なすぎる と、電圧保持率、整積電荷特性の向上をさせる効果が期待できず、多すぎると電圧保持率 特性を低下させる場合がある。

本発明の前記▲2♥の形態で用いられる重合体 [b] は、式 (I) で示される構造を有する重合体であれば特に限定されない。その具体例を挙げると、ポリエーテル、ポリエステル、ポリアミド、ポリアミド、ポリアミック酸、ポリイミド、ポリウレタンなどが挙げられる。

これらの重合体を得るためには、ポリエーテルでは、式(1)で示される構造を有する水 販温度鉄化合物とハロゲン屋銭化合物をアルカリの存在下で反応させるなどの方法、ポリ エステルでは、式(1)で示される構造を有するカルポキシ基置鉄化合物と多面アルシェ ルとの重縮合反応などの方法、ポリアミドでは、式(1)で示される構造を有する水 護鉄化合物との重縮合反応などの方法、ポリアミドでは、式(1)で示される構造を るカルポキシ基置鉄化合物とシアミン誘導体との重縮合反応や、式(1)で示される構造 を有するアミノ基電鉄化合物とカルポキシ基置鉄化合物との重縮合反応などの方法 を有するアミノ基電鉄化合物とカルポキシ基置機化合物と酸二無、ポリ専 アミック酸では、式(1)で示される構造を有するアミン基電機化合物と酸二無木物誘導 体との重縮合反応などの方法、ポリイミドでは、先に得られたポリアミック酸を、緊また は脱水閉線触媒で処理させたり、ポリウレタンでは、式(I)で示される構造を有するイ ソシアン酸エステル基値換化合物とグリコールとの重付加反応を行うなどの方法が一般的 である。

上述した式(1)で示される標準を有する水酸基醛 換化合物は、通常の有機合成的手法で 合成することができる。具体的には、水酸基3よびハロゲンを含むペンゼン誘導体を 旅 が新酸、ビリジンと反応させ水酸基を保護した後、112 N-Q-NH2。で示される一板がシ アミンまたはR-NH-Q-NH-Rで示される二級ジアミンとアルカリ存在下で反応さ せ、元の後、酸の存在下で反応させアセチル基を脱保護させて得ることが一般的である。 上述した式(1)で示される構造を有するカルボキシル基類機化合物は、通常の有機の シ野港で合成することができる。具体的には、カルボキシル基を保保した後、H2 N-Q-NH2。で示される一級ジアミンまたはR-NH-R-NH-Rで示される二級ジ アミンとアルカリ存在下で反応させ、その後、酸の存在下で反応させアセチルあるとは、 サウトルカリ存在でで反応させ、その後、酸の存在下で反応させアモチル基を保保機 ませて組ることが一般的である。

上述した式 (I) で示される構造を有するアミノ基置換化合物は、通常の有機合成的手法で合成することができる。具体的には、アミノ基およびハロゲンを含むベンゼン誘導体を酢酸の存在下で反応させアミノ基を保護した後、Hg、N(Q -NH- で示される一級ジアミンとアルカリ存在下で反応させ、その後、酸の存在下で反応させ、その後、酸の存在下で反応させてチル基を服保費させて得ることが一般的である。

上述した式(I) で示される標準を有するイソシアン酸エステル基置換化合物は、通常の有機合成的手法で会成することができる。具体的には、イソシアン酸エステル基含有ハログン簡単体をH₂ N-Q-NH₂ で示される一級ジアミンまたはR-NH-Q-NH-Rで示される二級ジアミンとアルカリの存在下で反応させることが一般的である。

本発明の、前配▲2▼の形態における、重合体 [b] の混合量は、ポリアミック酸反びポ リイミドから遊ばれる少なくとも1種の重合体の樹脂重量に対し、重量比で、0.01~ 0.5であり、好ましくは、0.1~0.3である。重合体 [b] の混合量が少なすぎる と、程圧保持率、磁積電荷特性の向上をさせる効果が期待できず、多すぎると電圧保持率 特性を低下させる場合がある。

本発明の、前配 $4 \le \nabla$ の形態で用いられる重合体 [c] は、式 (I) で示される構造を有するジアミン化合物を原料の一部として用いて、テトラカルボン酸およびその他のジアミン化合物との共重合によりポリアミック酸の重合体 [c] 得ることができ、さらに該ポリアミック酸をするド化することにより、ポリイミドの重合体 [c] を得ることができる。上記共重合に用いられる、テトラカルボン酸二無水物およびその他のジアミン化合物は、一般的にポリアミック酸およびポリイミドの重合に用いられるものであって、特に限定されるものではない。その具体例としては、前記 $\Delta 1 \lor 3$ よび $\Delta 2 \lor 0$ 形態に用いられるポリアミック酸で示したテトラカルボン酸二無水物およびジアミン化合物を用いることができる。

また、式(I)で示される構造を有するジアミン化合物は、通常のジアミン化合物と同様に用いることができるので、前配▲1▼および▲2▼の形態に用いられるポリアミック酸を得る方法および、ポリイミドを得る方法をそのまま適用することができる。

式 (1) で示される構造を有するジアミン化合物を得るには、式 (1) で示される構造を有するピスフェノール化合物と芳香族ハロゲン化ニトロ化合物をジメチルアセトラド中塩 返存在下で、120℃~140℃で反応させることでジニトロ化合物とし、さらにパラジカムーカーボンと水業によりニトロ基を運元してアミノ基に変換する方法などがある。重合体 [c] を得るに際の、式 (1) で示される構造を有するジアミン化合物の使用割合としては、反応させる総ジアミン化合物を1とした時に0.01~0.5で裁し、対よしくは0.05~0.3である。使用制合が少なすぎると、電圧保持率、蓄積等性の向上をさせる効果が期待できず、多すぎると電圧保持率特性を低下させる場合がある。

本発明の液晶配向処理剤に使用される溶媒は、含有される組成物を溶解させる物であれば

特に限定されないが、その例としては2-ピロリドン、N-メチルピロリドン、N-エチ ルビロリドン、N-ビニルピロリドン、N、N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチ ルホルムアミド、ャープチロラクトンなどが挙げられる。

また、単独では溶解させない溶媒であっても、溶解性を損なわない範囲であれば上配溶媒 に加えて使用することができる。その例としてはエチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、 エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレング リコール、1-メトキシー2-プロパノール、1-エトキシー2-プロパノール、1-ブ トキシー2-プロパノール、1-フェノキシー2-プロパノール、プロピレングリコール モノアセテート、プロピレングリコールジアセテート、プロピレングリコールー1ーモノ メチルエーテルー2-アセテート、プロピレングリコールー1-モノエチルエーテルー2 -アセテート、ジブロピレングリコール、2-(2-エトキシブロポキシ)プロパノール 、乳酸メチルエステル、乳酸エチルエステル、乳酸n-プロピルエステル、乳酸n-ブチ ルエステル、乳酸イソアミルエステルなどが挙げられる。

このようにして得られる本発明の液晶配向処理剤における固形分の含量は、均一な溶液で あれば特に限定されないが、通常、1~15重量%、好ましくは2~8重量%である。

また、ポリイミド樹脂膜と基板の密着性をさらに向上させる目的で、カップリング剤など の添加剤を加えることもできる。

本祭明の被晶配向処理剤は、基板上に均一な籐を形成した後、ラビングや光照射などで配 向処理をして、または配向処理無しで液晶配向膜として用いることができる。

本発明のおける液晶表示素子は、本発明の液晶配向処理剤を電極付き基板に塗布し、乾燥 、焼成、ラビングなどの処理を行い液晶配向膜とした後、公知の方法で液晶セルを作成し て液晶表示妻子とした物である。

電極付き基板の基材としては、ガラス、プラスチックなどの透明な物が使用でき、反射型 の液晶表示素子ではシリコンウエハー等の不透明な物でも片側の基板のみにならば使用で きる。同様に電極も、ITOなどの透明な材料の他、アルミ等の光を反射する材料でも反 射型液晶表示素子には使用できる。

本発明における液晶配向処理剤の塗布方法は、特に限定はされないが、例えば、ロールコ ーター法、スピンナー法、印刷法などが挙げられ、生産性の面から、工業的には転写印刷 法が広く用いられている.

配向処理制を塗布した後の乾燥は、壊成主での間に塗膜形状が変形しない程度に溶媒が蒸 発していれば良く、その乾燥手段については特に限定されない。

本際則における液晶配向処理剤の嫌成は、100~350℃の任意の濃度で行うことがで きるが、好ましくは150℃~300℃であり、さらに好ましくは200℃~250℃で ある。液晶配向処理剤中にポリアミック酸を含有する場合は、この焼成温度によってポリ アミック酸からポリイミドへの転化率が変化するが、本発明における液晶配向処理剤は、 必ずしも100%イミド化させる必要は無い。ただし、液晶セル製造行程で必要とされる 、シール剖硬化などの熟処理温度より、10℃以上高い温度で焼成することが好ましい。 上記焼成を行った後、必要に応じてラビングに代表される配向処理を行い、液晶配向膜と することができる。

以上のように、本発明の液晶表示素子は、本発明の液晶配向処理剤から形成された液晶配 40 向膜を備えた液晶表示素子であり、TN素子、STN素子、TFT液晶素子、更には、機 電界型の液晶表示素子、垂直配向型の液晶表示素子などネマティック液晶を用いた種々の 方式による表示素子に適用可能である。

以下に実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明するが、これに限定されるものではない

MeO (a-1) OMe 窒素雰囲気下中500mlの四つロフラスコにm-キシレン20ml、酢酸パラジウム(11)0.42g(0.0018mol)、tertープチルホスフェン1.5g(0. 0075mol)を入れ10分間機搾した後、4-プロモアニソール35g(0.187

(10)

moi] のmーキシレン溶放100mlを満下し、さらに10分間接神させた。 次に、N,N'ージフェニルペンジジン25m{0.075mol}のmーキシレン溶液 200mlを加えた後、ナトリウムー tertーブトキシド15.86g{0.165m ol}を入れ、110℃で3時間反応させた。反応終了後、容整中へ水を瀕下し、ジェチンエーテルにより抽出た。確酸ナトリウムにより脱水後、硫酸ナトリウムを3例し、エイレータにより縮葉を留去した。租生成物は、シリカゲルカラムクロマトグラフィー法 (クロロホルム:nーヘキサン=1:1)により精製を行い化合物(a-1)を得た。 <合成例2~

$$(a-1) \xrightarrow{\mathsf{BBr_3}} \mathsf{C_2H_4Cl_2} \xrightarrow{\mathsf{NO}} \mathsf{C_2H_4Cl_2} \mathsf{OH}$$

要素雰囲気下中、500mlの四つロフラスコに三臭化ホウ素16g (0. 16mol) - ジクロロエタン溶液100mlを入れ、一75℃に冷却した。化合物 (a-1) 18g (0. 038mol) を50mlのジクロロエタンに溶解させ、ゆっくり滴下した。前で後放冷し、8時間反応させた。反応終了後、水とジエチルエーテルを入れ油層を取り出し、硫酸ナトリウムにより脱水し、エバボレータにより溶薬を留去した。租生成物は、シリカゲルカラムクロマトグラフィー法(酢酸エチル:nーヘキサン=1:4)精製を行い化合物 (a-2) を得た。

蜜業雰囲気下中、200m1のナスフラスコに化合物(a-2)0. 124g (0. 00 057m01) と4-7ルオロベングフェノン0. 3g (0. 00057m01) と炭酸カリウム0. 13g (0. 001m01) をジナルアセトアミド(以下DMAcと略す) 20m1中、140℃で3時間反応させた。アセトンで再述精製を3回繰り返し精製を行い重合体(b-1) を得た。GPC法により測定した重合体(b-1) の数平均分子量は(Mn=15000, Mw=30000) であった。

$$(a-2) + P$$
 NO_2
 NO_2
 NO_2
 NO_2
 NO_2
 NO_2
 NO_2
 NO_2
 NO_2
 NO_2

(11)

$$(a-3) \xrightarrow{1,4-\text{dioxane}} \text{H2} \xrightarrow{\text{H2N}} \text{(a-4)}$$

200m1の四つロフラスコに化合物 (a-3) 6.5 g (0.0085mol)を1, 4-ジオキサン40mlに溶解させ、パラジウムー炭素(5%[Pd/C]) (0.00 017mol)を入れ水素質接を行か、60℃で48時間反応させた。反応終了後、パラジウムー炭素を3別し溶媒を留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー法 (クロロホルム・ジオキン=20:1)により精製を行い化合物 (a-4)を得た。 <み床側4>

《合成例5》 窒素気流下中、500mlの四つロフラスコに、DDE5.6g {0.028mol} NMP69.6gに溶解させた後、CBDA5.33g {0.0272mol}入れ、5 時間重合しポリアミック酸 (d)の溶液を得た。GPC法により測定したポリアミック酸 (d)の数平均分子量と重量平均分子量はそれぞれ、{Mn=30000, Mw=660 00}であった。 < 合成例6>

窒素雰囲気下中500mlの四つ口フラスコにm-キシレン25ml、酢酸パラジウム(Ⅰ1)0.435g{0.0019mol}、tert-ブチルホスフェン1.57g { 50 0.0078mol)を入れ10分間優幹した後、4-プロモアニソール15.95g {
0.0853mol}のmーキシレン籍被83mlを摘下し、さらに10分間提幹させた。
次に、N,N'ージフェニルー1,4-フェニレンジアミン10.09g {0.0388mol}のmーキシレン籍被150mlを加えた後、ナトリウムーtertーブトキシド11.17g {0.1163mol}を加えた後、ナトリウムーtertーブトキシド15.2万度をサライトろ通し、ろ液をエパポレータにより将整智去した。得られた残渣をジェチルエーテルにより再結晶し、代合物(a-5)を得た。

(12)

$$(a-5) \xrightarrow{BBr_3/CH_2Cl_2} HO$$

$$(a-6)$$

<合成例7>

産業気流下中、500m1の四つロフラスコに、3,4 - ジカルボキシー1,2,3,4 - テトラヒドロー1 - ナフタレンコハク酸二無木物8、4 g(0.028mol)をNMP69、1 gに溶解させた後、p - フェニレンジアミン2、73g(0.025mol)と1,3 - ジアミノー4 - オクタデシルオキシペンセン1.06g(0.0028mol)とと入れ、査護で10時間反応させポリアミック酸浴(を長た)

<合成例8>

蜜素気護下中、500mlの四つロフラスコに、3,4 - ジカルボキシー1,2,3,4 - テトラヒドロー1 - ナフタレンコハク酸二無木物8.4 g (0.02 mol)をNM P78.4 gに溶解させた後、p - フェニレンジアミン2.43g(0.022mol)と1,3 - ジアミノー4 - オクタデシルオキシペンゼン1.06g(0.0028mol)と化合物(α-4)1.95g(0.0028mol)とを入れ、蜜塩で10時間反応させポリアミック酸溶液を得た。

このポリアミック酸溶液50gにNMP75g、イミド化触媒として無水酢酸18g、ビリジン8.3gを加え、50℃で3時間反応させ、ポリイミド樹脂溶液を得た。この溶液を800mlのメタノール中に投入し、冷られた白色沈殿をろ別・洗浄し、乾燥し、ポリイミド(c-2)の粉末を得た。GPC治により稠定したポリイミド(c-2)の数平均分子最と表展であ分子歳はそれぞれ、[Mn=15000, Mw=50000]であった。

監票雰囲気下中、500mlの因つ口フラスコに化合物(a-7)9、81g $\{0.02$ $81mol\}$ -92 ρ 1 -92 ρ 2 +92

$$(a-8) + \bigvee_{F} NO_2 \frac{K_2CO_3}{DMF} O_2N - O_2 - O_2$$

(a - 9)

$$(a-9) \qquad \frac{\text{Dioxane, AcOH}}{\text{Pd-C/H}_2} \qquad \qquad \\ \text{H}_2\text{N-} \qquad \qquad \\ \text{O} \qquad \qquad \\ \text{N-} \text{N-}$$

(a-10)

500m1の四つロフラスコに化合物(a-9)5.11g {0.008mol}を1,4-ジオキサン36m1に溶解させた後、酢酸5.25m1-x2。63m1溶液を加えた。この反応溶液にパラジウム-炭素(5%[Pd/C]){0.00016mol}を入れ水素医機を行い、50℃で5日間反応させた。反応終了後、パラジウム-炭素を3別し溶薬を留去した。得られた表流をトルエンに溶解し、活性自土を加えた後、反応溶液を1時間遠流した。この反応溶液を濾過し、溶薬を留去することにより化合物(a-10)を構た。

<合成例10>

産素気流下中、500mlの四つロフラスコに、DDE5g(0.025mol)と化合物(a-10)1.62g(0.0028mol)とを、NMP67.7gに溶解させた 後、CBDA5.33g(0.0272mol)を入れ、5時間盛台レポリアミック酸(c-3)の溶液を得た。GPC法により測定したポリアミック酸(c-3)の溶液を得た。GPC法により測定したポリアミック酸(c-3)の数平均分子量と重量平均分子量はそれぞれ、(Mn=15000,Mw=35000)であった。

〈実施例】> 合成例5で得られたポリアミック酸(d)の溶液をNMPで希釈し、樹脂濃度4w t%と した。この溶液に、合成例1で得られた化合物(a−1)を添加し、2 4時間気搾して、 本発明の液晶配向処理剤を得た。化合物(a−1)の添加量はポリアミック酸(d)の樹 順分に対し、15w t%とした。

液晶セルの作成

ITO電網付基板に、上記の被島配向処理剤をスピンコートレ(1st:300rpm [500]、80℃にて5分間乾燥した後、200℃で60分間乾燥した後、200℃で60分間乾燥した。 盤腰面をラピング装置にてラピングして配向処理し、被晶配向膜とした。 6μmのスペーサーを被晶配向膜面に散布した後、ラピング方向が正交するように組みをわせ、チャップ6μmのツイストネマチック(TN) セルを作成した。このセルに液晶(メルク製:MLC-2003)を注入し、注入口を對止し液晶セルとした

電圧保持率および蓄稽電荷の評価

電圧保持率は、23℃または90℃で、液晶セルに±5℃、パルス幅64μs、周波数64Hzの電圧を印可し、測定を行った。

また、蓄積電荷は、直流 3 V を重畳した 3 0 H z / ± 3 V の矩形被を 2 3 ℃で 6 0 分印可 し、直流 3 V を切った直後の液晶セル内に残る蓄積電圧を光学的フリッカー 消去法で測定 1 →

その結果、電圧保持率は23℃で98%、90℃で72%であり、蓄積電荷は0.1Vであった。

<実施例2~実施例4>

実施例1において、化合物(a - 1)の添加量をそれぞれ5wt%、25wt%、40w t%とした以外は、実施例1と同様に被晶配向処理剤を調製し、評価を行った。この結果 は後述する表1に示す。

<実施例5~実施例7>

集施例1において、化合物 (a−1) に菱えて、合成例2で得られた重合体 (b−1) を されぞれ10wt%、15wt%、25wt%能加した以外は、実施例1と同様に液晶配 向処理利を調製し、評価を行った。この結果は後歩する表1に示す。

< 比較例1>

会成例5で得られたポリアミック酸 (d) の溶液をNMPで発釈し、樹脂濃度4wt%の 液晶配向処理剤とした。この液晶配向処理剤を実施例1と同様に評価した。この結果は後 述する変1に示す。

< 比較例 2 >

合成例 5 で得られたポリアミック酸 (d) の溶液をNMPで希釈し、樹脂濃度 4 w t % と した。この溶液に、N、N、N-トリフェニルアミン (以下TPAと略す)を添加し、2 4時間撤掉して、液晶配向処理剤とした。TPAの添加量はポリアミック酸(d)の樹脂 分に対し、10wt%とした。この液晶配向処理剤を実施例1と同様に評価した。この結 果は後述する表1に示す。

< 比較例3>

比較例3において、TPAの添加量を20wt%とした以外は比較例3と間様に液晶配向 処理剤を關製し、実施例1と同様に評価した。この結果は後述する表1に示す。

< 実施例8 >

合成側 4 で得られたポリアミック酸(c-1)の溶液をNMPで希釈し、樹脂濃度 4 w t %である本発明の液晶配向処理剤を得た。この液晶配向処理剤を、塗膜の焼成温度を23 0℃とした以外は実施例1と同様に評価した。なお、液晶セルは電圧保持率と蓄積電荷の 評価を行った後、60℃で24時間加熱処理し、再び電圧保持率と蓄積電荷の評価を行っ た。この結果は後述する表2に示す。

< 比較例4>

合成例 5 で得られたポリアミック酸 (d) の溶液を NMP で希釈し、樹脂濃度 4 w t %の 液晶配向処理剤とした。この液晶配向処理剤を、塗膜の焼成温度を230℃とした以外は 事施例1と同様に評価した。なお、液晶セルは重圧保持率と蓄積電荷の評価を行った後、 60℃で24時間加熱処理し、再び電圧保持率と蓄積電荷の評価を行った。この結果は後

主	1		
723	_		

		化合物(a)		重合体[b]		その他の化合物		電圧保持學		蓄積電荷
	重合体	模類	添加量	種類	添加量	種類	添加量	23℃	90°C	
実施例										
1	d	a-1	15	-	-	-	-	98%	72%	0.10
2	d	a-1	5	-	-	-	-	99%	68%	0.70
3	d	a-1	25		-	- 1	-	98%	54%	D. 1V
4	d	a-1	40	-	-	-	-	97%	39%	0.10
5	ď	-	-	b-1	10	-	-	98%	90%	ov
6	a	-	-	b-1	15	-	-	98%	91%	DV.
7	d	-	-	b-1	25	-		97%	87%	07
比较例								1		
1	d	-	-	-	-	-	-	98%	57%	10
2	d	-	_	-	-	TPA	10	97%	36%	17
3	ď					TPA	20	96%	34%	17

30

10

表 2

		液晶七儿	作成直後		60°C/	24時間処	理後
		電圧保持	本	蓄積電荷	電圧保持	丰	蓄積電荷
	重合体	23°C	90°C		23°C	90°C	
実施例 8 比較例	c-1	95%	67%	0. 1V	97%	69%	0. 1V
4	_ a `	98%	63%	1. 5V	95%	30%	1. 4V

<実施例9>

合成例10で得られたポリアミック酸 (c-3) の結液をNMPで希釈し、樹脂濃度4wt%である本発明の液晶配向処理剤を得た。この液晶配向処理剤を、塗膜の焼成温度を230℃とした以外は実施例1と同様に評価した。その結果、意圧保持率は23℃で98%、90℃で69%、蓄積電荷は0.3Vであった。

<実施例10>

< 実施例11>

奏鑑例10において、化合物(a-2)に替えて化合物(a-1)を添加し、24時間撹拌して、本発明の被晶配向処理剤を得た。化合物(a-1)の添加量はポリイミド(e)の徴脂分に対し、1~t%とした。この液晶配向処理剤を用い、強腰の焼成温度を230でとした以外は実施例1と同様に評価を行った。この結果は後途する表3に示す。

<実施例12>

実施例10において、化合物(a-2)に替えて化合物(a-6)を添加し、24時間機 押して、本発明の被晶配向処理剤を得た。化合物(a-6)の添加量はポリイミド(e) の樹脂分に対し、1w4分とした。この被晶配向処理剤を用い、強腰の読成程度を230 でとした以外は実施例1と同様に評価を行った。この結果は後途する表3に示す。

< 実施例13>

合成例8で得られたポリイミド(c − 2)の粉末をNMPに溶解させ樹脂濃度4wt%である本発明の液晶配向処理剤を得た。この被晶配向処理剤を、微顔の能成温度を230℃とした以外は実施例1と同様に評価した。この結果は後述する表3に示す。

< 比較例5 >

合成例7 で得られたポリイミド (e) の粉末をNMPに溶解させ樹脂濃度 4 w t%の液晶 配向処理剤とした。この液晶配向処理剤用い、塗膜の施成温度を 2 3 0 ℃とした以外は実 版例1 と同様に評価した。この結果は後述する表 5 に示す。

表 3

	重合体	化合: 種類	物[a] 添加量	電圧保持 23℃		蓄積電荷
Sta+#= 761	里百净	1里天具	旅川重	230	90℃	ļ
実施例 10	ө	a-2	1	99%	86%	0. 3V
. 11	e	a-1	1	99%	85%	0. 6V
12	e	a-6	1	99%	82%	0. 6V
13	c-2	-	- 1	99%	86%	ov
比較例						
5	е	-	_	99%	85%	1. 5V

10

産業上の利用可能性

式(1) で示される構造を含有する本発明のポリイミド系の液晶配向処理剤によれば、電圧保持率を向上させ、または殆ど低下させず、かつ蓄積電荷が低減された液晶配向膜を得ることができ、また、優れた液晶薬子を得ることができる。

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCE REPOR	er-	Descriptional new	oser No.
	Z-tipaconiziones santinarioni vi		. PCT/JI	02/05798
A. CLAS	DICATION OF SUBJECT MATTIE C1 COS1.79/08, COSK5/18, COSC7	3/10, G82F1	/1337	
According	townstiesel Patent Classification (IPC) or to both sa	Goal desiliation o	elifC	
E. FILD	SEARCHED			
Int.	C1 ⁷ C08179/00-79/08, C08C73/00 G1 ² C08179/00-79/08, C08C73/00 G02F1/1137	1-73/26, CDG:	K3/00-13/08	
December	de. Narried dijer (fran reklaser diengspaalsket te fra	street that such dec	arments are anchored	a 69 fields seembed
CAS	en have convenient ducing the haverandeed sents (seco	e of data been and, w	lean priorical At . ser	character)
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
CHÉLLA.	Caution of document, with indication, where up			Belevant to sleks No
Α	IF 9-238089 A (Oki Electric 18 Hovember, 1997 (18.11.97), Foll text (Family: noce)		, Ltd.),	1-9
٨	JP 6-238392 A (Coppen Printi 06 December, 1994 (06.12.90), Full text (Family: none)	ng Co., Itd.	.),	1-9
A	JP 62-280288 A (Nimmen Motor 05 December, 1987 (05.12.87), (Family: noos)			1-8
	US 3950886 A [Agence Nationa de la Recherche), 05 November, 1976 (09.11.76), Pall text - 5 JP 50-102481 A & DE 5 FR 2256541 A		ipation	2-8
Juro	or documents are littled in the occasionation of Best C.	☐ Separate	ally server	
T decem	compactor of PAM data makes and challenge for proceedings of the order which is set and the lot of producted michanics and the lot of producted michanics are which may claim for about the last and office are which may claim for about the protect of configure and the lot of the about the protect of configure and the lot of the about the lot of the about the lot of and the lot of and the lot of the lot of the lot of and the lot of the lot of the lot of and the lot of the lot of and t	atty when the if decreased of ye constituted by more than the more than the "A" fortunered many Date of mailtest of	occupied in these along decorat reference; the region on the model to and on more difference ing all flowers in 1 years has all the name public for all file name public	densed invention-cornel to pulse the riscornel st active each, such a shifted by the an family
C9 J	uly, 2002 (09.07.02)	23 July	2002 (23.	07.02)
Japa	nese fatent Office			
Pacebooks N		Telephone No.		

	国際資金銀行	pspssmmmませ PCT/3P0	2/05798
A. 表示の	ステる分野の分類(IIIII(新春分数(I PC))		
ln t.	C1" C081 75/08, C08K5/18	. C08G73/10, G02F1/1	337
Egeffoti	7った分野 後小家女件(知味物料分析(I PC))		
Int.	C1' COSL79/00-79/08, C08 COSK 3/00-13/08, G03	8G73/00-73/26 8F 1/1337	
秦小田東邦 郡:	いの登録で理念を行った分野に含まれるもの		
国際関連で使	目したモナゲータベース(ゲータベースの名称、	製造に他用した用類)	
CAS	BK1 1NO		
C. 2007	5と知められる文献 -		
別用文献の カテゴリート	CHIRL AU-NORSERNITA	とまは、その飲まする信所の表示	開送する
A	JP 9-298089 A (神電気: 1.18,全文 (ファミリーなし)	工条株式会社) 1997. 1	1-8
A	JP 6-338392 A (凸版印) 08,全文 (ファミリーなし)	BB株式会社)1994. 12.	1-8
A	JP 62-280288 A (日花) 2.05, (ファミリーなし)	自築本株式会社)1987、1	1-8
A	US 3990984 A. (Agence No	ationale de Valorisation de	1-8
CHOK	きにも文献が引用されている。	□ パテントファミリーに向ける3	新卡中院
「2」開発組 以際に	30ある文献ではなく、一般的姿勢水神を示す 重月形の助戦または神許である水、医群政策を 対象されたもの 主張に発展を操作する大赦又は他の大赦の発行	の日の独に出版された文献 「T」 開始機関ドスロを公司表に必要 選挙と矛盾するものではなく、 の関係のなかに対けするもの 「X」 特に認高のある文献であって、 の関係的文は連歩がかないと考 「Y」 特に認高のある文献であって、	製剤の転換支柱制施 含数支給のみで開発 とられるもの 質数支配と他の1以
Bボル・ 大赦 C	(は他の特別な適点を確立するために引用する 動かを付す) よる個別、使用、原示等に含まする大飲 関目前で、かつ便別後の生活の基礎となる出版	上の文献との、自奏者にとって、 よって満歩件がないと考えられ 「品」株一ペテントファミラー文献	1997かる 約金せ に 66の
京都 (で) 日本 (で)	自由を付す) よる歴象、従月、最易等に含品する大赦 以上前で、かつ使用性の主張の基礎となる出版	上の大致との、自身者にとって、	660
日本で 大数 (0) 日本に 「2) 日本に 「2) 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に 日本に	日本を付す) よる団の、使用、原外等に含まする文献 関目前で、かつ便別域の主張の基礎となる出版 アレカ目	上の文献との、自集者にとって よって高が作がないと考えられ 「品」株一ペテントファミラー文献	660

引用文献の カテゴリーキ	WEST-CAUGH-CASE MINISTRAL SERVICE AND ASSESSMENT OF SERVICE AND ASSESSMENT OF SERVICE AS A SERVI	· 全生	を表する 数文の表記でま
カテゴリーキ	in Rachercha) 1976, 11, 09 & JP 50-142481 A &D	· 全生	Brogues
	&JP 50-142481 A &D	, <u>&\$</u> E 2614629 A	
	&JF 50-142481 A &D	E 2614629 A	
			1
			1
1			
}			i
			1
ĺ			1
.			1
- 1			
			1
			1
			I
1			1
			ı
			1
- 1			1
			1
			1
1			1
			1
			i
			1
			1
			i
1			1
			1
			I

PERCENCIPA (DIA (DIA (WAS ALMAN) (ADDA (WAS

フロントページの続き

(72) 発明者 遠藤 秀幸 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学工業株式会社 電子材料研究所内

(注) この公表は、国際事務局 (WIPO) により国際公開された公報を基に作成したものである。 なおこの公表に 係る日本部特許出願 (日本語美月研奏登録出版) の国際公開の効果は、特許送第184条の10第1項(実用新奏法 第48条の13第2項) により生ずるものであり、本編載とは関係ありません。